RANCANG BANGUN SISTEM PELURUSAN MASKER PADA PROSES FOTOLITOGRAFI

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Strata Satu Sistem Komputer

Oleh:

Abdul Kholiq
10211042

Pembimbing:
Ayub Subandi, M.T

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BANDUNG

2017